薄膜ニオブ酸リチウム基板を用いたプラズモニック垂直入射光変調器の提案

Proposal of Surface-Normal Plasmonic Optical Modulator on Lithium Niobate Thin Film Substrate

東大院・エ¹,浜松ホトニクス(株)²^(M1)宮野 広基¹, (M2)相馬 豪¹,

(D)福井 太一郎¹, 野本 佳朗², 種村 拓夫¹, 中野 義昭¹

The Univ. of Tokyo.¹, Hamamatsu Photonics K. K.², ^OHiroki Miyano¹, Go Soma¹, Taichiro Fukui¹, Yoshiro Nomoto², Takuo Tanemura¹, Yoshiaki Nakano¹ E-mail: miyano-hiroki@hotaka.t.u-tokyo.ac.jp

1. 背景

将来の高密度光インターコネクト、センシング、 光演算等の応用に向けて、高速に動作し、大規模 並列化が可能な垂直入射型光変調器が求められ ている[1]。このような要求に応える素子として、 金属と電気光学ポリマー材料を組み合わせたプ ラズモニック垂直入射型光変調器が報告されて いる[2-4]。今回、電気光学材料としてニオブ酸リ チウム (LN: lithium niobate) 薄膜基板[5]を用い たプラズモニック垂直入射変調器を新たに提案 し、その性能を検証したので報告する。

2. 提案素子の概要

提案構造をFig.1に示す。下面金ミラー上にLN 薄膜を形成した基板を用い、その上面にサブ波長 周期の金格子構造を作製する。素子に垂直に入射 されたTM光は、金格子の周期に応じて決まる波 長において、金属-誘電体-金属(MIM: metalinsulator-metal) 共振器モードに高効率に結合し、 金属により吸収されるため、反射スペクトルにお いてディップが生じる。上下の金電極に電圧を印 加することで電気光学効果を介してLN層の屈折 率を変調し、共振波長をシフトさせることで反射 率の変調を行う。

3. 結果

2次元有限差分時間領域(FDTD)法により、提 案素子の反射特性を計算した。

Z-cutのLN 膜の厚みを 500 nm、上下の金電極の 厚みを 100 nm、格子幅と周期の比を 0.825 とし、 格子周期を変えたときの TM 光の反射スペクト ルの計算結果を Fig.2 に示す。格子周期が波長 以下となるサブ波長領域において、回折が抑圧 され、MIM モードによる鋭い共振が得られるこ とが分かる。

一例として、格子周期を 710 nm のときの変調結 果を Fig. 3 に示す。例えば、波長 1569 nm におい て、±10 V の電圧で挿入損失 3.6 dB、消光比 4.6 dB の強度変調が得られる。LN 材料の高速変調特 性、及び、紫外域から遠赤外域に至る広透過帯域 特性を用いることで広範な分野への応用が期待 される。



Fig. 1. (a) Schematic of proposed device structure. (b) Cross-sectional view of the structure



Fig. 2. Simulated reflection spectrum of TM light as a function of grating period. The ratio of grating width and the period is fixed to 0.825. The thickness of LN film is set to 500 nm.



Fig. 3. Modulated reflectance spectrum of TM light under an applied voltage from -10 V to +10 V. Grating period, width, and the LN film thickness are set to 710 nm, 586 nm, and 500 nm, respectively.

参考文献

- [1] U. Koch et al., J. Lightw. Tech. 37, 1484 (2019).
- [2] M. Ayata et al., Science. **358**, 630 (2017).
- [3] J. Zhang et al., Appl. Phys. Lett. 113, 231102 (2018).
- [4] J. Zhang et al., Opt. Express 25, 30304 (2017).
- [5] G. Poberaj et al., Las. Photon. Rev. 6, 488 (2012).